② 総合評定値通知書の写し（改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの）
③ 営業所一覧表（様式２）及び建設業許可申請書の営業所一覧表の写し
④ 委任状（行政書士等が代理申請をする場合に限る。）

4 競争参加資格の再認定

競争参加資格の審査は、下記の客観的事項について、次の順に従って行います。

① 客観的事項について施工能力点を付与します。
② 土木、舗装、電気、建築については各工種ごとに、施工能力点の高得点順に契約予定金額に対応する等級を付し、再認定します。

客観的事項

１）営業規模
・工事種別ごとの年間平均完成工事高
・自己資本の額（又は平均自己資本額）
・平均利益額
２）経営状況
３）技術力
４）社会性等

5 再認定の結果の通知

弊社ホームページにおいて「有資格者名簿」への記載をもって通知に代えることとします。

6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間

2025・2026年度（令和７・８年度）を有効期間とする競争参加資格については、再認定の日から令和９年３月31日までとします。

招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和８年７月６日

国立大学法人東北大学副学長　伊豆　仁志

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第７号

1 調達内容

⑴ 品目分類番号　24
⑵ 導入計画物品及び数量　クライオ透過電子顕微鏡装置　一式
⑶ 調達方法　購入等
⑷ 導入予定時期　令和８年12月以降
⑸ 調達に必要とされる基本的な要求要件

① クライオ専用透過型電子顕微鏡

A 電子源は干渉性の高い冷陰極電界放出型電子銃であること。エネルギー分解能（半値幅）はモノクロメーターを用いることなく0.4eV以下であること。
B 加速電圧は300kV以上であること。
C １軸で±70°以上の試料傾斜ができること。自動試料交換装置は、装置内に12個以上の試料を保持し、自動で試料を交換できること。
D 電子顕微鏡像、電子回折図形に寄与する電子のエネルギーを選択できるエネルギーフィルターを鏡筒内に内蔵していること。
E 低角散乱電子由来のコントラストを強調する位相板を有していること。
F 高感度電子線直接露光カメラ（階調16ビット以上、5,760×4,092ピクセル以上、毎秒1,500フレーム以上）とともに、電子回折図形を記録するため電子線照射に耐性の高いカメラ（４ｋ×４ｋピクセル以上）を有していること。

② 真空蒸着装置

アモルファスカーボン薄膜作成のための蒸着装置

A ターボ分子ポンプで排気し、到達真空度は１×10^{-4}Pa以上であること。

③ 親水化処理装置

グリッドの前処理に必要な親水化装置

A 電極サイズが直径50mm以上であり、静電シールド電極を有していること。

④ 自動グリッド浸漬凍結装置

クライオ電顕試料作製のための急速凍結装置

A 環境チャンバーは４℃～60℃を含む範囲以上で温度調整ができること。
B 液体窒素容量は１リットル以上でかつ１時間以上の保持ができること。

2 資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴ 資料等の提供期限　令和８年８月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵ 提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　河村　紘明　電話022―217―4869

3 説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴ 交付期間　令和８年７月６日から令和８年８月６日まで。
⑵ 交付場所　本公告の日から東北大学財務部調達課ホームページ（https://www.bureau.tohoku.ac.jp/keiyaku/kouhyou/）において、電子ファイルにて交付する。

4 説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴ 開催日時　令和８年７月15日14時00分
⑵ 開催場所　オンライン開催とする。（詳細は、導入説明書による。）

5 その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6 Summary

⑴ Classification of the products to be procured : 24
⑵ Nature and quantity of the products to be purchased : Cryogenic Transmission Electron Microscope 1 Set
⑶ Type of the procurement : Purchase
⑷ Basic requirements of the procurement :

① A cryogenic transmission electron microscope.

A It should be equipped with a cold field emission gun, which produces a highly coherent electron beam. The energy spread is supposed to be less than 0.4 eV without using a monochromator.
B The accelerating voltage should be higher than 300 kV.
C The specimen can be tilted more than ±70° and the automated specimen exchange system should be equipped. It must be able to contain up to 12 grids at the same time.
D The energy of electrons contributing to images and diffraction patterns should be selected by using an in-column type energy filter.
E The microscope should have the phase plate system to enhance the small-angle scattered electron image contrast.
F The system should contain a highly sensitive direct electron detector for image recording. It has 24 megapixels (5,760 × 4,092) field of view and the readout speed of 1,500 full frames per second. It should also have a tough camera for electron beam irradiation suitable for recording diffraction patterns with more than 4k × 4k pixels.

② A vacuum evaporator

This is needed to prepare amorphous carbon layer for grid preparation.

A The evacuation should be done by a turbomolecular pump and reachable vacuum degree should be higher than 1×10^{-4} Pa.

③ A glow discharger

This is needed to hydrophilize the surface of the grid for grid preparation.

A The size of the electrostatic shield electrode should be larger than 50 mm in its diameter.

④ An automated grid plunging device

This is needed to perform plunge-freezing for vitrification of specimens.

A The temperature of the specimen chamber should be controllable at the range from 4 ℃ to 60 ℃.
B The container should keep 1 ℓ liquid nitrogen for one hour.

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　6 August, 2026
⑹ Contact point for the notice : Hiroaki Kawamura, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan TEL 022―217―4869